## 宇宙機搭載用デブリセンサの開発状況

松本晴久(JAXA),北澤幸人(JAXA研究開発本部・客員),長谷川直(JAXA)

1. はじめに

2003年10月25日、環境観測技術衛星「みどり2号」(ADEOS-II)の太陽パドルの発生電 カが3分間で6kWから1kWまで低下する異常運用が発生した[1]。この原因究明の結果、ハ ーネスへの微小粒子の衝突もその要因の1つとしてあげられた[2]。この不具合事故を機に JAXA においてデブリに関連する「宇宙環境標準」及び「デブリ防御標準」制定作業が開始 された。衝突試験等の結果、大きさ100µm~数mmのデブリは、宇宙機にクリティカルな 故障・障害を引き起こすことが明らかになったものの、従来の計測データが乏しいことに より、デブリ衝突のリスク評価に不可欠な「デブリ衝突頻度」予測値には2桁に及ぶ不確 定性があることが判明した[3]。

従来のメテオロイドデブリ用のセンサ(ダストカウンタ)では、メテオロイド&デブリ の「衝突」エネルギーを他の物理現象(振動、プラズマ、電磁波等)に変化することを利 用し、その物理現象を計測する。そのため、計測面積の大規模化が困難であり、大きさ100 µm~数mmのデブリの計測には必ずしも適していなかった。また、センサに生じる現象と 衝突パラメータ(速度、粒径、材質)とを関連付けるために多くの超高速度衝突試験(パ

ラメータ・サーベイ)が必要であった。本センサーは 宇宙機にクリティカルな故障・障害を引き起こすこと が予想されるものの、その軌道上の存在量(衝突フラ ックス)が不明確な数百µm~数mm程度の大きさのデ ブリの存在量を正確に計測することに特化して研究 開発を行っており、単純な原理・大面積化の容易さ・ 少ないパラメータサーベイを特徴としている[4]。

現在の開発状況について述べる。

2. 計測原理

センサは、ポリイミドなどを材質とする絶縁性薄膜 (例えば、厚さ10ミクロン程度)上に、エッチング などの技法により、ピッチ(空間周期)100ミクロン 以下の直線状の細長い導線(以後、検出線と呼ぶ)の パターンを印刷する(右図参照)。

例えば、検出線のピッチが100ミクロンの場合、100 ミクロン程度以上の有効直径を有するデブリが薄膜 に衝突すると、1本以上の検出線が破断する。このよ



うな検出線の破断を電気的に検出することにより、メテオロイド&デブリの衝突を検知する。

機能としては、「切断された検出線の識別」、「切断された時刻を特定」を行うことに在る。 同時刻に隣り合う複数本の検出が切断された場合には、それらの本数を同時切断するだけ の大きさのメテオロイド&デブリが衝突したと判断でき、メテオロイド&デブリのサイズ を推定することが可能である。

昨年度までの成果

平成 20 年度、平成 21 年度に実施した結果から得られた「フィルムの孔の直径/フィルム 厚さ」と「プロジェクタイル直径/フィルム厚さ」の関係を図 2 に示す。図から分かるとお りフィルム厚が  $12.5 \mu$  m  $\sim 25 \mu$  m 程度であればダストの直径に対するフィルムの直径(= 検出線の破断数)に大きな相違は生じないことが分かった。平成 20 年度に使用した試験体 は、ポリミドフィルム厚  $12.5 \mu$  m または  $25 \mu$  m、導線層は、 $0.1 \mu$  m 厚以下の Al である。 平成 20 年度に使用した試験体は、ポリミドフィルム厚  $12.5 \mu$  m、導線層は、厚さ約  $6 \mu$  m の Cu+約  $2 \mu$  m の Ni,Au である。

図 3 に検出線の破断数とプロジェクタイル径の関係を示す。プロジェクト径は、以下の 式1~式3で表すことができる。ここで、nは、検出線の本数、pは、検出線のピッチ幅、 dは、検出線の幅とする。

$$D_p(Maximum) = 1.39 \times 10^{-1} (np + d + p)^{1.28}$$
 . . . . . (1)

$$D_p(Nominal) = 1.39 \times 10^{-1} (np+d)^{1.20}$$

$$D_{p}(Minimum) = 1.39 \times 10^{-1}(np+d-p)^{1.28}$$



「プロジェクタイル直径/フィルム厚さ」の関係



...(2)

....(3)

図3検出線の破断数とプロジェクタイル径の関係

## 4. 今年度の成果

昨年度まで試験で、センサの原理は確認できたものの、センサ部の大型化とセンサ部と 回路部の接続の信頼性向上が課題として残っていた。センサと回路基板を別々に作成し、 それを接続すると方法から、フレキシブルプリント基板製造技術を応用するこで、1枚の大 型の「フレキシブルプリント基板」としてセンサ部と接続部を一体で製造するという発想 の転換を行った。製造に成功すると共に JAXA 認定用プリント基板技術の延長で製造でき ることが確認でき、宇宙開発品と同等の品質検査・保証体制を維持できる目途がたった。 図4に完成したセンサの写真を示す。



図4 完成したセンサ (センサ領域: 35 cm (W) × 35 cm(L) =1225 cm<sup>2</sup> / 1 unit)

まとめ

来年度、衝突角をパラメータとした試験を実施する予定である。

今後、本センサへの検出回路部の一体化等の機能拡充を実施し、なるべく早い時期にフ ライトし、宇宙樹のリスク評価・信頼性向上、宇宙環境監視・保全へのタイムリーな情報 提供に貢献したい。

参考文献

[1] ADEOS-Ⅱ不具合原因究明チーム、「ADEOS-Ⅱ不具合原因究明概要」第 1 回宇宙環境シン ポジュウム(2004年12月) p.84-92

[2] ADEOS-II 不具合原因究明チーム、「ADEOS-II 100W 発生電力変動調査」第1回宇宙環境シンポジューム(2004年12月) p. 128-135

[3]Fukushige, S., Akahoshi, Y., Kitazawa, Y., Goka, T., "Comparison of Debris Environment Models: ORDEM2000, MASTER2001 and MASTER2005", IHIENGINEERING REVIEW, 40(1), February 2007.

[4] H. Matsumoto, Y. Kitazawa, A. Sakurai, K. Funakoshi, T. Yasaka, Issues related to micro-debris and its measurement, the journal ofspace technology and scienc, 24, 2, 2009